

受託分析：レーザー顕微鏡観察

【レーザー顕微鏡について】

光源から照射されたレーザーを対物レンズを通して試料表面で集光させます。集光点で生じた光はビームスプリッターにより検出器側へ反射しピンホールを通り検出されます。このピンホールにより、ピントのあった箇所の情報を得ることができます。

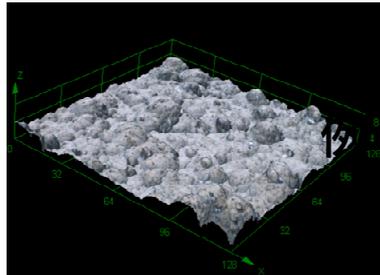
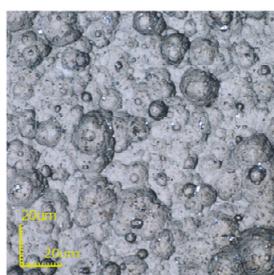
【試験方法】

表面の粗さの観察、膜剥がれの状態観察が可能です。

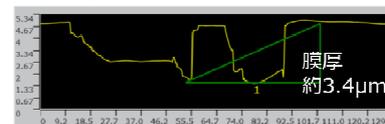
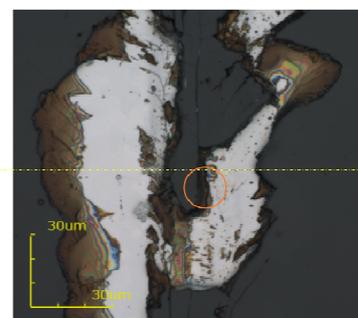
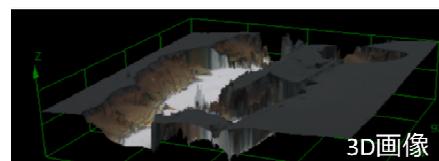
レーザー顕微鏡により3D表示や深さの計測も可能です。

膜のトラブル時の詳細観察や材料の面粗さ（Sa 算術平均高さ、Sz 最大高さ等）の測定まで幅広く対応できます。

試験機:Olympus社製LEXT OLS4000



表面状態の観察結果及び3D画像



はく離部分の3D画像と深さ測定

【適用範囲 測定事例】

[摩耗痕の形状・断面積測定]

対物レンズ：20x、貼合せ：X-5面 Y-1面

測定範囲：X,Y 2957×645µm

測定範囲：Z 200µm（高速モード 0.8µmピッチ）

[表面粗さ：Sa]

対物レンズ：50x、貼合せ：無し 1面

測定範囲：X,Y 258×258µm

測定範囲：Z 10µm（高精度モード 0.06µmピッチ）

ナノテック株式会社 表面分析センター lab@nanotec-jp.com

TEL:04-7135-6152(表面分析) / 04-7135-6111(代表) FAX:04-7135-6126

正規代理店：(株)ウエキコーポレーション、リックス(株)

SAC-E133 Ver.1